

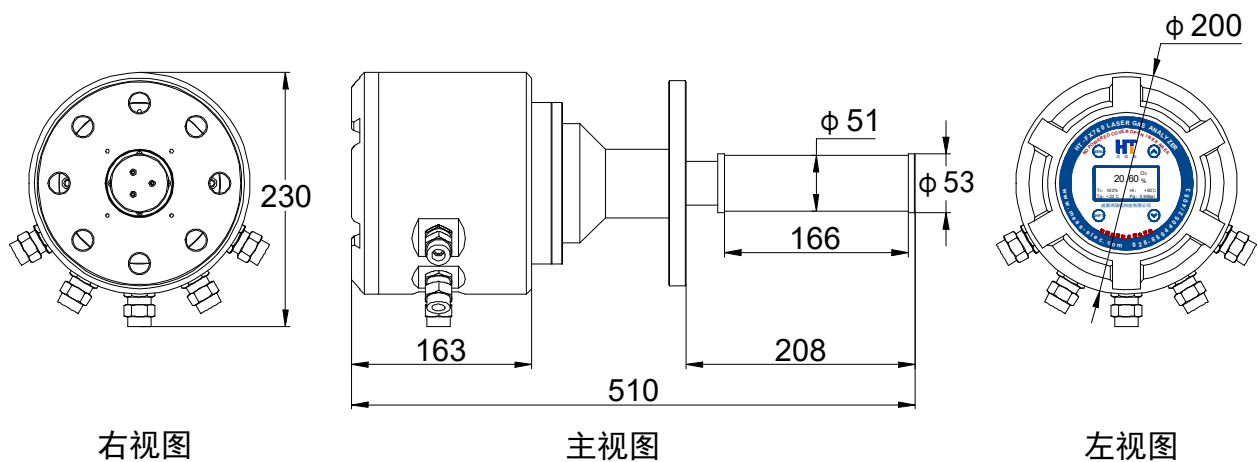
HT-FX760激光气体分析仪

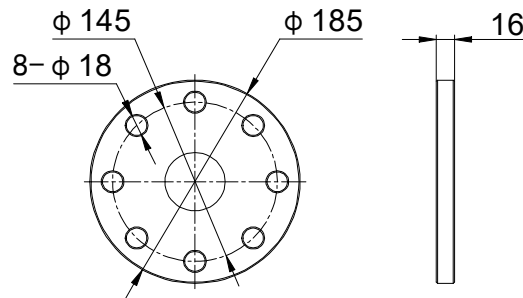


概述:

HT-FX760激光气体分析仪是一款针对国内外工业在线分析、环保在线监测研制的隔爆型可调谐半导体激光气体分析仪。该仪表可在多种复杂工况下，在线分析O₂、CO、CO₂、NH₃、CH₄、C₂H₂、C₃H₈等在内的多种气体，并具有测量精度高、响应速度快、安全可靠、维护简单等特点，为生产优化、能源回收、安全控制、环保监测和科研分析带来极大的方便。

外型尺寸(mm):





DN65 PN1.0法兰尺寸

技术参数:

- 测试原理: TDLAS (可调谐半导体激光吸收光谱)
- 测试组份: O_2 、 CO 、 CO_2 、 NH_3 、 CH_4 、 C_2H_2 、 C_3H_8
- 测试范围: 0~100%
(注: 每套分析仪测一种组份气体浓度, 组份、量程可定制)
- 显示方式: 128×64点阵OLED
- 分辨率: 0.01%
- 光路长度: 1.5m
- 线性误差: $\leq \pm 1\%.FS$
- 零点漂移: $\leq \pm 1\%.FS/年$
- 量程漂移: $\leq \pm 1\%.FS/半年$
- 响应时间: $T_{90} < 10s$
- 维护周期: $\leq 2次/年$, 清洁光学窗片
- 标定周期: $\leq 2次/年$
- 输入接口: 2路4-20mA输入 (温度、压力补偿)
- 输出接口: 2路4-20mA输出 (氧浓度、透过率, 最大负载电阻 $< 1K\Omega$)
2路可编程继电器干触点型报警输出, 触点最大容量AC220V/2A
- 通讯接口: RS485
- 工作电源: $DC24V \pm 10\%$, $< 20VA$
- 存储环境温度: $-20^\circ C \sim +60^\circ C$
- 工作环境温度: 表头: $-20^\circ C \sim +50^\circ C$
探头: $-20^\circ C \sim +80^\circ C$
- 环境湿度: $< 90\%RH$, 非冷凝
- 采样方式: 扩散式

- 工作压力：0.8~1.4bar，探头最高耐压5bar
- 标定气路接口：NPT1/8内螺纹
- 证书编号：CNEx23.0412X
- 防爆等级：Ex db IIC T6 Gb
- 防尘等级：Ex tb IIIC T80°C Db
- 防护等级：IP66
- 传感器寿命：>5年（正常使用情况下）
- 仪表净重：16.8Kg
- 安装方式：插入式，标准DN65 PN1.0法兰安装

仪器特点：

- a. 高亮OLED主动发光显示，显示直观；
- b. 采用TDLAS（可调谐半导体激光吸收光谱）技术，测量不受背景气体交叉干扰；
- c. 多次反射光路设计，提供了更长的有效光程，提高了测量的精度和准确性；
- d. 配置聚四氟乙烯过滤装置，过滤掉杂质的同时保证了光学信号透过率，易于清洁和更换；
- e. 镜面加热功能，预防粘性物质附着，保持镜面清洁；
- f. 自动温度和压力补偿，消除温度和压力变化对测量值的影响；
- g. 4万条历史数据自动存储功能，用户可随时本地查阅历史数据；
- h. 仪表支持多点分段线性标定，满足全量程范围内氧含量的准确测量；
- i. 采用隔爆设计，安全系数高；
- j. 结构设计紧凑，可靠性和稳定性好，响应速度快，可实时反映被测气体浓度；
- k. 可通过隔离式磁性笔现场直接操作仪表参数设置，无需断电；
- l. 标准DN65 PN1.0法兰对接安装，安装快捷便利。

应用场合：

应用于生物反应器、堆肥（处理）、气体发生、残氧测量、自动惰封系统、溶剂罐、化学/制药反应、沼气/填埋气体氧监、化工，制药，钢铁，环保，食品等行业气体浓度检测分析。

订货须知(用户订货时请注明)

- 测量范围
- 背景气体组份